

Title (en)

METHOD FOR CLEANING A SURFACE AND VACUUM CONNECTION METHOD, AND RETROFITTING SET FOR A SURFACE CLEANING DEVICE, SURFACE CLEANING DEVICE, AND VACUUM CONNECTING DEVICE COMPRISING A SURFACE CLEANING DEVICE

Title (de)

REINIGUNGSVERFAHREN ZUM REINIGEN EINER OBERFLÄCHE UND VAKUUMVERBINDUNGSVERFAHREN SOWIE NACHRÜSTSATZ FÜR EINE OBERFLÄCHENREINIGUNGSVORRICHTUNG, OBERFLÄCHENREINIGUNGSVORRICHTUNG UND VAKUUMVERBINDUNGSVORRICHTUNG MIT OBERFLÄCHENREINIGUNGSVORRICHTUNG

Title (fr)

PROCÉDÉ DE NETTOYAGE PERMETTANT DE NETTOYER UNE SURFACE ET PROCÉDÉ DE RACCORDEMENT SOUS VIDE, AINSI QU'ÉLÉMENT DE RÉÉQUIPEMENT POUR UN DISPOSITIF DE NETTOYAGE DE SURFACE, DISPOSITIF DE NETTOYAGE DE SURFACE ET DISPOSITIF DE RACCORDEMENT SOUS VIDE DOTÉ D'UN DISPOSITIF DE NETTOYAGE DE SURFACE

Publication

EP 3815801 A1 20210505 (DE)

Application

EP 19206111 A 20191030

Priority

EP 19206111 A 20191030

Abstract (en)

[origin: WO2021083644A1] The invention relates to the cleaning of surfaces to be joined to free them of impurities that disrupt the joining, for example oxides, with a process gas. In order to be able to perform the cleaning efficiently and with reduction or even avoidance of unwanted effects, the invention envisages, prior to contact of the process gas with the surface, measurement of the concentration of the process gas in a feed gas and of the composition at least of portions of an offgas containing reaction products from the cleaning, and use of the process gas concentration and the offgas composition in order to assess the progress of the current cleaning.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft die Reinigung von zu verbindenden Oberflächen von die Verbindung störenden Verunreinigungen, beispielsweise Oxiden, mit einem Prozessgas. Um die Reinigung effizient und unter Verringerung oder gar Vermeidung von ungewünschten Effekten durchführen zu können, ist erfindungsgemäß vorgesehen, vor dem Kontakt des Prozessgases mit der Oberfläche die Konzentration des Prozessgases in einem Zufuhrgas und die Zusammensetzung zumindest von Teilen eines Reaktionsproduktes der Reinigung enthaltenen Abgases zu messen und die Prozessgaskonzentration sowie die Abgaszusammensetzung zu verwenden, um den aktuellen Reinigungsfortschritt zu bewerten.

IPC 8 full level

B08B 5/00 (2006.01); **C23G 5/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

C23G 5/00 (2013.01); **B08B 5/00** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] EP 3006602 A1 20160413 - AIRBUS DS GMBH [DE]
- [I] DE 102004061269 A1 20060614 - SIEMENS AG [DE]
- [A] US 2006086376 A1 20060427 - DIMEO FRANK JR [US], et al
- [A] US 2012186604 A1 20120726 - TAKANO KENSUKE [JP], et al
- [A] JP 2017183472 A 20171005 - TOSHIBA MEMORY CORP
- [A] KORZEC D ET AL: "CLEANING OF METAL PARTS IN OXYGEN RADIO FREQUENCY PLASMA: PROCESS STUDY", JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: PART A, AVS /AIP, MELVILLE, NY., US, vol. 12, no. 2, 1 March 1994 (1994-03-01), pages 369 - 378, XP000442717, ISSN: 0734-2101, DOI: 10.1116/1.579249

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 3815801 A1 20210505; WO 2021083644 A1 20210506

DOCDB simple family (application)

EP 19206111 A 20191030; EP 2020078550 W 20201012